

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第6部門第1区分
【発行日】平成30年5月24日(2018.5.24)

【公開番号】特開2017-110935(P2017-110935A)
【公開日】平成29年6月22日(2017.6.22)
【年通号数】公開・登録公報2017-023
【出願番号】特願2015-243299(P2015-243299)
【国際特許分類】

G 0 1 N 23/20058 (2018.01)

【F I】

G 0 1 N 23/20 3 5 0

【手続補正書】

【提出日】平成30年3月28日(2018.3.28)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

電子線源と、
電子線源からの電子線を集束する集束レンズと、
電子線をさらに集束することにより試料上に電子プローブを形成する対物レンズと、
試料上で電子プローブを走査する走査コイルと、
ほぼ鉛直下向きに入射する電子線により試料から生じる電子線後方散乱回折(electron back scattering diffraction: EBSD)パターンを検出するEBSDパターン検出器と、

入射する電子線に対する試料の傾斜角及び配置を変更する試料ホルダーと、
を備え、EBSDパターンにより試料の結晶方位を解析するEBSD検出装置であって、
前記EBSDパターン検出器において、EBSDパターン検出器の配置を変更することなく、EBSDパターンを撮影する撮像素子部の試料に対する仰角を調整することにより、反射型EBSD法と透過型EBSD法の双方により解析が可能なEBSD検出装置。

【請求項2】

前記撮像素子部は、上端部にヒンジを備え、
該ヒンジにより撮像素子部をEBSDパターン検出器本体と回動自在に連結し、
EBSDパターン検出器の長手方向に前進又は後進する棒状体で撮像素子部を回動することにより撮像素子部の試料に対する仰角を調整する
請求項1に記載のEBSD検出装置。

【請求項3】

前記撮像素子部は、該撮像素子部を構成要素とするカメラと一体化している請求項1又は2に記載のEBSD検出装置。

【請求項4】

前記撮像素子部は、仰角を20度～50度に調整する請求項1～3のいずれかに記載のEBSD検出装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0009】

本発明のEBSD検出装置は、電子線源と、電子線源からの電子線を集束する集束レンズと、電子線をさらに集束することにより試料上に電子プローブを形成する対物レンズと、試料上で電子プローブを走査する走査コイルとを備える。また、ほぼ鉛直下向きに入射する電子線により試料から生じるEBSDパターンを検出するEBSDパターン検出器と、入射する電子線に対する試料の傾斜角及び配置を変更する試料ホルダーとを備え、EBSDパターンにより試料の結晶方位を解析する。本発明のEBSD検出装置では、EBSDパターン検出器において、EBSDパターン検出器の配置を変更することなく、EBSDパターンを撮影する撮像素子部の試料に対する仰角を調整することにより、反射型EBSD法と透過型EBSD法の双方により解析が可能である。